MSAP向け貫通孔対応ビアフィリング用 硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating (MSAP) For Via-filling and Through-hole Plating

-ップルチナ

TOP LUCINA VT

- ●浴組成のハイスロー化に対応することで良好な膜厚均一性を実現 Applicable to bath for high throwing power, great uniformity in film thickness
- 優れたビアフィリング性能と高いスルーホールめっき性能を両立 Realize great performance in via-filling and through-hole plating
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能 Quantitative analysis is possible for all additives

より低伝送損失へ

For less transmission loss

MSAP



サブトラクティブ法 Subtractive process

回路も微細化し、 MSAPが主流となる

pattern-size becomes more fine and

膜厚ばらつきが小さい

トップルチナVT **TOP LUCINA VT**

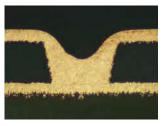
ビアフィリング性能に優れる

Great via-filling performance

トップルチナVT TOP LUCINA VT



従来浴 Conventional bath



硫酸銅五水和物:150g/L CuSO₄·5H₂O

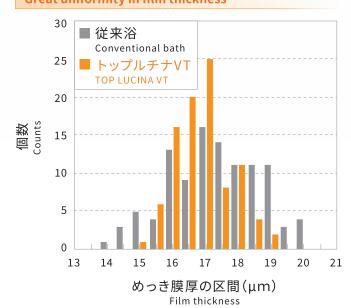
> 硫酸:150g/L H₂SO₄

電流密度: 2.0A/dm2 Current density

穴径:110μm Hole diameter

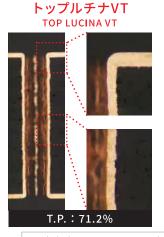
深さ:60μm Hole depth

膜厚分布の均一性に優れる **Great uniformity in film thickness**



サブトラクティブ法でも高性能!

High performance is obtained also in subtractive process.



従来浴

Conventional bath

電流密度: 2.0A/dm2

穴径: 0.3mm Hole diameter

板厚:1.6mm Board thickness

: 56.2%

高スローイングパワー Great throwing power